



# 检 测 报 告

## TEST REPORT

报告编号: KDHJ248703

检测类别:	委托检测
项目名称:	废气检测
委托单位:	无锡华润上华科技有限公司

江苏康达检测技术股份有限公司  
KANG DA TESTING TECHNOLOGY (JIANG SU) Co., Ltd.



# 声 明

一、本报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；本报告无编制、审核、签发者签名无效。

二、本检测报告只对所检样品的检测结果负责；对委托单位自行采集的样品，本公司仅对送检样品负责。

三、用户对本报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。

四、未经本公司书面批准，不得以任何形式复制（全文复制除外）本报告；任何对本报告的涂改、伪造、变更及不当使用均无效，其责任人将承担相关法律及经济责任，本公司保留对上述行为追究法律责任的权利。

五、除客户特别申明并支付样品保管费外，超过合同约定保存时间或标准规定时效的样品均不再保留。

六、本公司对本报告的检测数据保守秘密；除客户特别申明并支付档案管理费或法律规定的特殊要求外，本次已存档的检测报告保存期限为 6 年。

地 址：中国 江苏省 苏州市 苏州工业园区 长阳街 259 号钟园工业坊 3、4 栋

邮政编码：215000

电 话：0512-65733680

电子邮件：zyf@ehscare.org

检测报告

委托单位	无锡华润上华科技有限公司		
通讯地址	江苏省无锡市新吴区锡士路		
联系人	徐铭毅	联系电话	18861813800
采样日期	2024-08-22	分析日期	2024-08-22~2024-08-23
检测目的	为客户了解污染物排放情况提供检测数据。		
检测结论	检测结果见表1。		
<div>编制：黄琰</div> <div>审核：邵娇娇</div> <div>签发：许晨</div> <div>检测机构检验章</div> <div>江苏康达检测技术股份有限公司 检验检测专用章</div> <div>签发日期：2024 年 09 月 05 日</div>			

表 1-1 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.0	22.2	22.2	22.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		44032	43787	44248	44022	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	0.23	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.57	0.34	0.24	0.38	10
	排放速率（kg/h）	0.017				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计）。					

表 1-2 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.2	22.0	22.0	22.1	/
标态烟气量（Nm³/h）		44045	45442	45571	45019	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-3 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-001 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.4	22.0	22.2	22.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		43914	44032	44045	43997	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-4 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		21.5	21.4	21.1	21.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		46785	48041	48075	47634	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	0.24	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.84	0.21	0.32	0.46	10
	排放速率（kg/h）	0.022				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计）。					

表 1-5 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		21.6	21.8	21.6	21.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		48065	49050	49860	48992	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					



表 1-6 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-002 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		21.5	22.1	21.6	21.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		46785	47299	48065	47383	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	1.1	0.4	5.0
	排放速率（kg/h）	0.019				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-7 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.0	21.9	21.8	21.9	/
标态烟气量（Nm³/h）		39986	39447	42609	40681	/
氮氧化物	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
硫酸雾	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度（mg/m³）	0.23	ND	0.38	0.24	10
	排放速率（kg/h）	9.8×10 <sup>-3</sup>				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氯化氢的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 10L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-8 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		21.9	22.2	22.7	22.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		40695	40839	43249	41594	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-9 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-003 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.0	21.9	22.0	22.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		39986	40695	42339	41007	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-10 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		27.1	18.7	18.7	21.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		27217	29646	30063	28975	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	0.20	0.39	ND	0.23	5.0
	排放速率（kg/h）	6.7×10 <sup>-3</sup>				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.83	0.38	0.32	0.51	10
	排放速率（kg/h）	0.015				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计）。					

表 1-11 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.2	19.0	18.7	19.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		27128	25256	28030	26805	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-12 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.2	19.1	19.3	19.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		28974	28828	27839	28547	/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-13 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-004 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		27.1	19.2	19.2	21.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		27217	27128	28974	27773	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	0.6	0.6	0.4	5.0
	排放速率（kg/h）	0.011				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-14 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.3	22.4	22.3	22.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		39776	38282	36559	38206	/
氮氧化物	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
硫酸雾	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度（mg/m³）	ND	0.32	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氯化氢的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 10L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					



表 1-15 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.9	22.2	23.1	22.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		36935	36850	37079	36955	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-16 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-010 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.3	22.9	23.1	22.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		39776	36935	37079	37930	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-17 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		23.8	24.0	24.3	24.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		28552	29962	28101	28872	/
氮氧化物	排放浓度（mg/m³）	ND	7	5	4	50
	排放速率（kg/h）	0.12				/
硫酸雾	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	0.26	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度（mg/m³）	1.19	0.76	1.95	1.30	10
	排放速率（kg/h）	0.038				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-18 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		24.1	24.2	24.5	24.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		27638	28213	30314	28722	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-19 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-012 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		23.8	24.3	24.5	24.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		28552	28101	30314	28989	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-20 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.6	19.8	19.7	19.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		32382	33842	32662	32962	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	2.94	0.33	0.95	1.41	10
	排放速率（kg/h）	0.046				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计）。					

表 1-21 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.7	22.4	22.4	21.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		32662	30960	31107	31576	/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	4	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-22 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.4	22.4	22.4	22.4	/
标态烟气量（Nm³/h）		30960	31107	31493	31187	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-23 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-013 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		19.6	19.7	22.4	20.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		32382	32662	31493	32179	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	1.4	0.5	5.0
	排放速率（kg/h）	0.016				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					



表 1-24 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		23.5	23.6	23.5	23.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		25207	26042	26365	25871	/
氮氧化物	排放浓度（mg/m³）	4	6	ND	4	50
	排放速率（kg/h）	0.10				/
硫酸雾	排放浓度（mg/m³）	ND	0.31	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度（mg/m³）	0.47	0.29	1.12	0.63	10
	排放速率（kg/h）	0.016				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-25 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		23.6	23.3	22.6	23.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		25626	24959	25950	25512	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计）。					

表 1-26 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-014 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		23.5	23.5	22.6	23.2	/
标态烟气量（Nm³/h）		25207	26365	25950	25841	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-27 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		21.5	21.7	21.7	21.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		29665	30411	30521	30199	/
硫酸雾	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	5.0
	排放速率（kg/h）	/				/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.31	1.36	0.44	0.70	10
	排放速率（kg/h）	0.021				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，硫酸雾的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 400L 计）。					

表 1-28 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		22.1	22.1	21.8	22.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		30622	30623	29866	30370	/
氟化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	1.5
	排放速率（kg/h）	/				/
氮氧化物	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	50
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氟化物的检出限为 0.06mg/m³（采样体积以 150L 计），氮氧化物的检出限为 3mg/m³。					

表 1-29 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-015 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		21.5	21.8	22.1	21.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		29665	27785	30622	29357	/
氯气	排放浓度(mg/m³)	1.3	ND	ND	0.5	5.0
	排放速率（kg/h）	0.015				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯气的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 5L 计）。 4、氯气均值为三小时均值。					

表 1-30 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-005 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		28.5	28.8	29.1	28.8	/
标态烟气量（Nm³/h）		11426	11180	10837	11148	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-31 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-006 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		26.7	26.9	26.1	26.6	/
标态烟气量（Nm³/h）		16385	15871	16601	16286	/
氨	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-32 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-011 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		27.5	27.2	27.9	27.5	/
标态烟气量（Nm³/h）		13327	13834	13501	13554	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-33 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-016 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		28.2	28.6	28.2	28.3	/
标态烟气量（Nm³/h）		17447	17436	18313	17732	/
氨	排放浓度（mg/m³）	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					



表 1-34 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-017 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		30.1	29.8	30.0	30.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		20874	20650	21247	20924	/
氨	排放浓度（mg/m³）	0.26	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-35 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-050 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		酸喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		34.9	35.0	35.2	35.0	/
标态烟气量（Nm³/h）		1298	1213	1248	1253	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-36 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-021 废气排气筒		排气筒高度（m）		25
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		31.7	31.3	32.1	31.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		5636	5345	5818	5600	/
氯化氢	排放浓度(mg/m³)	0.97	0.36	2.37	1.23	10
	排放速率（kg/h）	6.9×10 <sup>-3</sup>				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。					

表 1-37 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-049 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		碱喷淋				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		35.5	35.8	35.9	35.7	/
标态烟气量（Nm³/h）		2083	1961	2030	2025	/
氯化氢	排放浓度（mg/m³）	2.63	0.45	ND	1.06	10
	排放速率（kg/h）	2.1×10 <sup>-3</sup>				/
备注	1、排气筒高度由受检单位提供。 2、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 3、“ND”表示未检出，氯化氢的检出限为 0.2mg/m³（采样体积以 10L 计）。					

表 1-38 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-051 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		活性炭吸附				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	均值	排放限值
烟气温度（℃）		35.2	35.5	35.4	35.4	/
标态烟气量（Nm³/h）		1810	1743	1906	1820	/
氨	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	ND	10
	排放速率（kg/h）	/				/
备注	1、排放限值：《半导体行业污染物排放标准》（DB32/3747-2020）表 3 限值。 2、“ND”表示未检出，氨的检出限为 0.25mg/m³（采样体积以 10L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 1-39 固定污染源废气检测结果表

点位名称		FQ-051 废气排气筒		排气筒高度（m）		33.5
净化设施		活性炭吸附				
检测项目		第一批次	第二批次	第三批次	最大值	排放限值
烟气温度（℃）		35.2	35.7	36.2	/	/
标态烟气量（Nm³/h）		1810	1767	1810	/	/
硫化氢	排放浓度(mg/m³)	ND	ND	ND	/	/
	排放量（kg/h）	/	/	/	/	1.8
臭气浓度	无量纲	35	30	26	35	15000
备注	1、排放限值：《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 2 限值。 2、“ND”表示未检出，硫化氢的检出限为 0.008mg/m³（采样体积以 9L 计）。 3、排气筒高度由受检单位提供。					

表 2 检测依据表

检测项目	检测依据
有组织废气	
氟化物	《大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法》（HJ/T 67-2001）
氯化氢	《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》（HJ 549-2016）
硫酸雾	《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》（HJ 544-2016）
氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》（HJ 693-2014）
氯气	《固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法》（HJ/T 30-1999）
氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》（HJ 533-2009）
臭气浓度	《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》（HJ 1262-2022）
硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 2007 年 第五篇第四章 十（三）
备注	/

表 3 仪器一览表

仪器编号	仪器名称	仪器型号
F-001-13	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-001-14	紫外-可见分光光度计	TU-1810PC
F-010-06	离子色谱仪	883
F-010-08	离子色谱仪	883
F-014-13	离子计	PXSJ-216F
X-015-34	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H
X-015-38	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H
X-015-44	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H
X-015-52	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H
X-015-53	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H
X-015-72	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H
X-015-73	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H
X-015-74	自动烟尘(气)测试仪	崂应 3012H
X-016-09	智能双路烟气采样器	崂应 3072
X-016-20	智能双路烟气采样器	崂应 3072
X-016-22	智能双路烟气采样器	崂应 3072
X-016-24	智能双路烟气采样器	崂应 3072
X-016-25	智能双路烟气采样器	崂应 3072
X-016-26	智能双路烟气采样器	崂应 3072
X-016-31	智能双路烟气采样器	崂应 3072
X-016-32	智能双路烟气采样器	崂应 3072
X-016-44	全自动烟气采样器	MH3001
X-060-72	充电便携采气桶	labtm009

\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*